**【セミナー開催のご案内】**2017/09/12

**光形状計測セミナー（第２回）**

**『実践に役立つ センスと知識を習得する』**

　日本光学測定機工業会では、第2回　光形状計測セミナー

「実践に役立つセンスと知識を習得する」を下記のごとく開催いたします。

　本セミナーは、光形状計測に特化し、光や画像による計測法の実践に役立つ基礎知識や関連技術を知ることで、技術者のレベルアップを目指すものです。

光に関する歴史的なエピソードやそれに関連する現象の紹介を交えながら、光形状計

測を体系的に理解できるようにします。

　申込は、事前に申し込み用紙に必要事項を記載の上、日本光学測定機工業会\_事務局

あてメールにて提出してください。

申込用紙は、工業会ホームページの『光形状計測セミナー』内からダウンロードし、

ご使用下さい。　ホームページアドレス　<http://www.j-oma.jp>

申込み受付後、申込者様に受講票と請求書を送付いたします。

（但し、申込期限後の申込は、当日受付にて受講票をお渡しいたします。）

※参加費の払い戻しは致し兼ねますので、ご都合悪くなった場合は、代理の方の出席を

　お願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

講　　　師：有賀　亨氏（元キヤノン株式会社　生産技術本部　生産技術研究所　部長）

開　催　日：２０１７年１１月２８日（火）１０：００～１７：００（予定）

会　　　場：機械振興会館　地下３階　Ｂ３－９

参加人数　：最大２４名（先着順）

 　　※申込多数の場合は開催場所変更も考慮いたします。

参加費用　：10,000円/人　；　一般

 5,000円/人　；　会員（正会員、特別会員、賛助会員）

 　　　テキスト；印刷版とテキスト内容収納ＣＤを配布します。

問い合わせ先： 〒105-0011

 東京都港区芝公園3－5－8

　　 日本光学測定機工業会　事務局

　　　 TEL・FAX　03-3435-8083

　　　　　 E-Mail：info@j-oma.jp

【講師の略歴】

　　有賀　亨

 東京大学大学院博士前期課程（修士課程）修了（物理学）

 キヤノン株式会社入社

 成形レンズの開発、微細デバイス開発、研究開発企画に従事

 生産技術開発や製品開発の開発革新に参加、加工プロセスや製品動作の実験的な

 解明を行う。その主要ツールとして各種計測技術を広く開発。

【プログラム】

1. イントロダクション １０：００　～　１１：４５

・光についての基礎知識

　　幾何光学と波動光学の基礎を知る

・誤差の計算方法

　　誤差を正しく見積もるための基本を知る

・技術センス

　課題から解を見出す能力の本質を紐解く

－　昼食・休憩　－ １１：４５　～　１２：４５

1. 形状計測 １２：４５　～　１５：３５（休憩10分含む）

・形状計測の全体像

　　計測技術の基本思想を大枠で捉える

・いろいろな形状計測手法

　　個別手法ごとの計測原理を理解する

　：　三角測量法

　：　干渉計測法

　：　合焦法

1. 実践で起こりえる課題 １５：４５　～　１７：００

・“反射”“ノイズ”等の現場でよく起こる課題を題材に、

　解に至る“技術センス”の活用法を学ぶ

 以上